

Inhalt

	Seite
Vorwort	1
Nanomess- und Positioniertechnik	
<i>E. Manske, T. Hausotte, G. Jäger</i>	3
<i>T. Wiedenhöfer</i>	17
<i>W. K. Wiedmann, D. Imkamp, F. Bader</i>	29
<i>H. Spaan, I. Widdershoven</i>	41
Taktile Messverfahren	
<i>R. Christoph, I. Schmidt</i>	51
<i>E. Treffers, E. Bos, T. Moers</i>	61
Optische Messverfahren	
<i>G. Wiora, M. A. Weber, J. Valentin</i>	71
<i>M. Prantl, R. Danzl, F. Helmlí</i>	83
<i>F. Depiereux</i>	93

		Seite
<i>C. Rembe,</i> <i>S. Boedecker</i>	Weißlichtinterferometer für die Fertigungsmesstechnik – Von der Forschung in die Anwendung	99
<i>B. Brodmann,</i> <i>J. Seewig,</i> <i>M. Wendel</i>	Von der Linie zur Fläche, winkelauflösende Streulicht- messtechnik	111

Volumen-Orientierte Messverfahren

<i>A. Krüger,</i> <i>S. Donner,</i> <i>T. Ripken</i>	Grundlagen und Anwendungen der Optischen Kohärenztomographie (OCT) – OCT für Implantat- forschung, Laryngoskopie und Augenchirurgie	123
<i>U. Neuschaefer- Rube,</i> <i>M. Bartscher,</i> <i>M. Schulze,</i> <i>M. Neukamm,</i> <i>A. Staude,</i> <i>J. Goebbels</i>	Messung von Mikrogeometrien mit industrieller Computertomographie	137
<i>L. Koenders,</i> <i>M. A. Weber</i>	Aktivitäten im FA 3.41 – Oberflächenmesstechnik im Mikro- und Nanometerbereich	149
<i>E. Manske,</i> <i>R. Füßl</i>	Bericht des Fachausschusses 3.44: Dimensionelles Messen in der Mikro- und Nanomesstechnik	157

Charakterisierung und Rückführung

<i>J. Seewig,</i> <i>C. Wiehr,</i> <i>S. Gröger</i>	Charakterisierung technischer Bauteiloberflächen – Stand der Oberflächenmesstechnik heute	159
<i>R. Krüger-Sehm</i>	Normen und Normale für die flächenhafte Rauheitsmess- technik	173

Anwendungen – Teil 1

<i>I. Erichsen</i>	Messtechniken zur Bestimmung der Eigenschaften asphärischer Optiken	185
<i>R. Schmitt, S. Bichmann, D. Köllmann, G. F. Mallmann</i>	Messung optischer Funktionsflächen und Referenz- marken für die replikative Optikfertigung	187
<i>W. Lyda, F. Mauch, W. Osten</i>	Artefakte bei der optischen Messung von Oberflächen am Beispiel konfokaler und weißlichtinterferometrischer Sensoren	197
<i>A. Weckenmann, W. Hartmann</i>	Funktionsorientierte Bewertung mikrostrukturierter Oberflächen – Modellgestütztes Charakterisieren und Bewerten funktionsbestimmender geometrischer Merk- male am Anwendungsbeispiel strukturierter Druckwalzen	207

Anwendungen – Teil 2

<i>T. Hausotte, A. Weckenmann, A. Schuler</i>	Tunnelstromtaster für die Mikrokoordinatenmessung	217
<i>P. Drabarek, M. Fleischer</i>	Vermessung der Innengeometrie von Mikrobohrungen mit einem interferometrischen Tastsystem	227
<i>K. Schmidt</i>	Messtechnik im Umfeld der Ultrapräzisionszerspanung	237